2010年3月

内部光電効果法を用いた SrTiO₃の界面誘電率測定

物質系専攻 086014 川村 元秀

指導教員:Harold Y. Hwang(教授)

キーワード:酸化物界面、ショットキー接合、内部光電効果法

背景 酸化物界面は特異な物性を示すことから、多くの研究者の興味を集めている。例えば、 バンド絶縁体同士であるにも関わらず金属的な伝導性を示す LaAIO₃/SrTiO₃ ヘテロ接合[1]、磁場 に依存する整流特性を示す La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃. /Nb:SrTiO₃ ショットキー接合[2]などがあげられる。高 品質の単結晶が得られ、ドーピングにより伝導性を制御できる SrTiO₃ は、最も代表的な酸化物の 一つであり、その界面の理解は酸化物の幅広い応用の基礎となる。SrTiO₃ の誘電率は温度や電場 に強く依存し、これがバンドベンディングひいては物性に大きな影響を及ぼすことが予想される。 従って、ペロブスカイトを用いた機能性酸化物を設計するためには、バルクではない界面近傍の SrTiO₃ の誘電率を実験的にプロープすることが欠かせない。本研究では、Au/Nb:SrTiO₃ (Nb = 0.01 wt%)ショットキー接合の障壁高さ(SBH)を内部光電効果(IPE)法[3]を用いて評価し、電圧を印加し た際に生じる SBH の変化から界面誘電率を見積った。

SBH が変化する機構としてはいくつかの可能性が考えられるが、その一つに電極金属側への界 面電場の浸み出し効果[4]があげられる。これによる SBH の低下は、電場の金属側への侵入長、界 面電場の強さと界面誘電率の積で与えられる。侵入長を適当に仮定すれば、電圧印加によって界 面電場を変化させたときの SBH を測定することで、界面誘電率をフィッティングにより求めるこ とができる。



図1 IPE 測定系の模式図。

実験方法 測定系の概観を図1に示した。光源に300 W のハロゲンランプを用い、出力光を回折格子で単色化し、 チョッパーで80 Hz に変調した上で試料に照射した。光 電流はロックインアンプを使用して復調した。今回、試 料にバイアス電圧を印加するため、新たに直流電圧源 (Yokogawa 7651)を導入した。実験装置の動作確認のため、 Au/GaAsショットキー接合のSBHのバイアス電圧依存性 を測定し文献値と良い一致を得ることに成功した。

Au/Nb:SrTiO₃ ショットキー接合は真空蒸着法を用いて 作製した。真空チャンバー内でビスマス蒸着-脱着処理 [5]によって基板表面に吸着した炭素などの不純物を除 去した後、活性酸素プレアニールを施し、*in situ* で金を 蒸着した。図2に示すように、この二つの表面処理の導 入により、光電流測定の妨げとなる逆バイアス漏れ電流 は激減した。

実験結果 実験により得られた 300 K における IPE スペ クトルを図 3 に示す。Nb:SrTiO₃ に対し Au に印加した逆 バイアス電圧の増大とともに光収率は増加し、光収率の閾 値として観測される SBH は系統的に減少した。光電流の 位相が誤差の範囲内でチョッパーの参照信号から変化が ないことから、光電流が金属側から半導体側への電子の放 出に起因することを確認した。

次に、SBH の変化の界面電場(E)依存性を調べた。図 4 に示すように、SBH の変化量が界面における電場の強さ に比例することから、SBH の減少は主に電極金属側への 界面電場の浸み出し効果に由来することがわかった。な お、界面電場の強さは電気容量-電圧(C-V)特性から求めた。

測定は室温から 125 K の範囲で行った。この範囲内で は IPE スペクトルの形状に大きな変化はみられなかった。 各温度について SBH の変化から界面誘電率を導き、これ を C-V 特性から求めた界面誘電率とバルクの誘電率と比 較したものを図 5 に示す。C-V 特性から求めた界面誘電 率は、ほぼバルクと同様の値と温度依存性を示した。IPE 法より求めた界面誘電率も、定性的には温度の低下に伴 って増加する傾向がみられ、定量的にも比較的よく一致 した。ここで、電極金属への電場の侵入長を 0.3 と仮 定したが、これは金のトーマス・フェルミの遮蔽長であ



図 2 Au/Nb:SrTiO₃ショットキー接合 の電流電圧特性。破線は表面処理な し、実線は表面処理ありを表す。



図 3 300 K における Au/Nb:SrTiO₃ ショットキー接合の IPE スペクトル。



図 4 SBH の変化の界面電場依存 性。

る 0.59 より少し小さい。この相違はおそらく金の誘 電率が1でないことによるものと考えられる。

考察 上で考慮した電場の浸み出し効果以外にも SBH 低下の機構が存在する。金属/半導体界面を通過す る電子が感じる鏡像ポテンシャルも SBH を変化させ得 る。これによる SBH の低下は界面電場(E)の平方根に比 例するが、実際図 6 に示すように、SBH の変化の E 依存 性をよく説明した。しかしながら、これより求まる誘電 率は、図 7 に示すように、300 K を除いた全ての温度で 1 を下回り非物理的である。よって、この系では鏡像ポ テンシャルの SBH に対する影響は小さいと考えられる。

まとめ Au/Nb:SrTiO₃ (Nb = 0.01 wt%)ショットキー接合の SBH を IPE 法によって評価した。電圧印加によって生じる SBH の変化は、界面電場の金属側への浸み出し効果に起因することがわかり、それから界面誘電率を導出することに成功した。求められた界面誘電率は、C-V 特性から求めた界面誘電率とバルクの誘電率と同様に、温度の低下に伴い増大した。定量的には、これら三つの誘電率は2倍程度の誤差の範囲内で一致した。従って、300 K から 125 K までの温度領域で SrTiO₃の界面誘電率は、少なくともバルクの誘電率と同じオーダーであることが結論できる。本研究の成果は、LaAlO₃/SrTiO₃ へテロ接合をはじめとする酸化物界面におけるバンドベンディングの計算の精緻化に資するものである。

1000 - -O-IPE - O-IPE - O-IP

図 5 IPE 法、C-V 特性、バルク(計算) から求めた界面誘電率の温度依存性。



図 6 SBH の変化の界面電場の平方 根に対する依存性。



参考文献

[1] A. Ohtomo and H. Y. Hwang, Nature 427, 423(2004).
[2] N. Nakagawa *et al.*, Appl. Phys. Lett. 86, 082504(2005).
[3] Y. Hikita *et al.*, Appl. Phys. Lett. 90, 143507(2007).
[4] S. S. Perlman, IEEE Trans. Electron Devices ED-16, 450(1969).

[5] S. Watanabe et al., J. Vac. Sci. Technol. A 9, 2394(1991).

学会発表

1. 応用物理学会 2010 年春季年会 「内部光電効果法を用 いた強内部電場下における SrTiO₃の誘電率測定」.

図 7 鏡像ポテンシャルモデルを仮定 して求まる誘電率。